

電漿式聚焦電子顯微鏡(PFIB)

一、系統規格及型號：

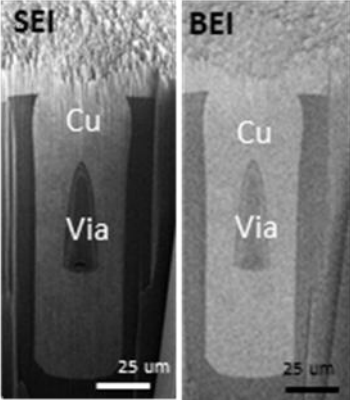
1. 規格(SPEC)

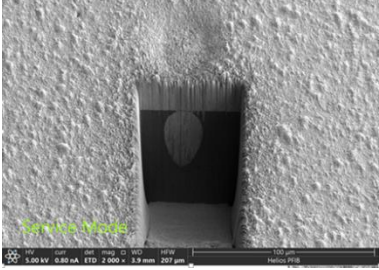
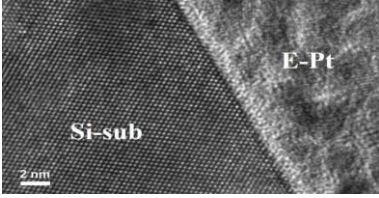
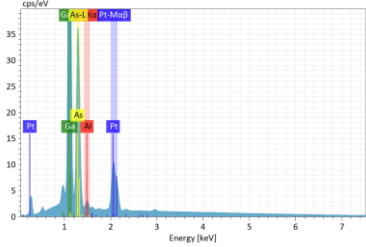
- (1) 電子源：Schottky field emission gun
- (2) 場發射電子束：
 - 可偵測二次電子及背向散射電子影像。
 - 電子束可控加速電壓範圍: 350 V – 30kV。
 - 電子束可控電流範圍: 0.8 pA – 100 nA。
- (3) 聚焦離子束：
 - 4 種 Xe, O, Ar, N 離子束氣
 - 離子束可控加速電壓範圍: 500 V – 30kV。
 - 離子束可控電流範圍: 1.5pA – 2.5μA。
- (4) 提供白金沉積於保護層於樣品表面。
- (5) 腔體大小內徑 ≥ 370 mm。
- (6) EDS 元素分析儀。

二、系統外觀:(結構如下圖所示)



三、使用功能說明:

分析項目	檢測說明	範例
1 SEM 分析	影像觀測	

2	試片製備	1. 大截面積 SEM 試片 (200 um X 300 um) 2. TEM 試片	 
3	EDS	檢測樣品之元素組成	

分析技術特性:

1. 限制：粉末、磁性物質、含水份與高分子與有機物質無法觀測。
2. 電荷蓄積效應，樣品需導電性良好，對導電性差的樣品，可鍍上導電性佳的金屬於表面(如 Pt...)，增加其導電性。
3. 區域標記與辨識：請於待加工區域周圍進行明確標記，有助於 FIB 下快速定位並提升製程效率與重現性。
4. 聯絡方式、收費標準及委託連結

TEM 試片製備-郭先生 03-5773693#7735 ; E-mail : bhkuo@niar.org.tw

SEM/EDS/EBSD-許小姐 03-5773693#7751 ; E-mail : sct@niar.org.tw

✓ 聯絡方式：

聯絡窗口	分機	Email	儀器位置
郭柄豪	7735	bhkuo@nlar.org.tw	R215
許瓊姿	7751	sct@nlar.org.tw	R215

✓ 收費標準：

設備編號	設備名稱	收費標準		
		自行操作 收費標準 (元/小時)	委託代工 收費標準 (元/小時)	備註
NM-024	電漿式聚焦電子顯微鏡(PFIB)	12,000	18,000	
註：委託代工時數未達半小時(30 分)者以半小時計。				

✓ 委託連結：

委託服務申請請至: [MES 系統](#) 及 [對外服務系統](#) 申請